**Nazwa przedmiotu:**

Aparatura w systemach zapewnienia jakości

**Koordynator przedmiotu:**

dr hab. inż. Sabina Żebrowska-Łucyk, prof. nzw. PW; doc. dr inż. Jan Tomasik; dr inż. Ryszard Rudziński

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechatronika

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

brak

**Semestr nominalny:**

7 / rok ak. 2012/2013

**Liczba punktów ECTS:**

4

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Wykład: 24 godziny
Przygotowanie do egzaminu i egzamin: 18 godzin
Laboratorium: 18 godzin
Przygotowanie do ćwiczeń:18 godzin
Wykonanie sprawozdań:22 godzin
Razem 100 (4 ECTS)

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Wykład: 24 godziny
Laboratorium: 18 godzin
Razem 42 (1,5 ECTS)

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

Laboratorium: 18 godzin
Przygotowanie do ćwiczeń:18 godzin
Wykonanie sprawozdań:22 godzin
Razem 58 (2 ECTS)

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 360h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 270h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Wymagana jest znajomość treści zawartych w przedmiotach: Fizyka, Matematyka w zakresie probabilistyki i statystyki, Podstawy technik wytwarzania, Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych, Zarządzanie jakością, Grafika inżynierska, Podstawy metrologii, Metrologia techniczna, Informatyka w systemach pomiarowych

**Limit liczby studentów:**

Brak

**Cel przedmiotu:**

Pogłębienie wiedzy na temat czynników kształtujących poziom jakości wyrobów, zwłaszcza czynników kształtujących strukturę geometryczną powierzchni. Zapoznanie się z metodami pomiarowymi związanymi z kontrolą przebiegu procesów wytwarzania elementów maszynowych oraz nabycie umiejętności interpretacji wyników pomiaru w powiązaniu z parametrami procesów wytwarzania. Zdobycie wiedzy i umiejętności zakresu oprogramowania systemów do akwizycji danych w systemach pomiarowych.

**Treści kształcenia:**

Rola aparatury pomiarowej w systemach zapewnienia jakości. Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych do kontroli geometrycznej wyrobów mechanicznych.
Elementy geometryczne w normach PN-EN-ISO (integralne, pochodne, nominalne, rzeczywiste, zaobserwowane, skojarzone). Pojęcie wymiaru wirtualnego. Zasady zależnego specyfikowania tolerancji wymiarów i tolerancji geometrycznych. Wpływ układu baz na interpretację symboli specyfikacji – przykłady. Algorytmy obliczania elementów skojarzonych. Parametry odchyłek geometrycznych: symbolika, definicje, właściwości, zastosowanie.
Metody pomiaru odchyłek kształtu powierzchni o krzywiźnie stałej o krzywiźnie zmiennej oraz powierzchni nominalnie płaskich. Analiza harmoniczna profili powierzchni – metoda obliczeń, interpretacja, zastosowania.
Wykorzystanie wyników badania geometrii wyrobów do diagnostyki procesu technologicznego i prognozowania właściwości eksploatacyjnych wyrobów. Metody pomiaru odchyłek położenia i odchyłek kierunku, interpretacja wyników.
Urządzenia do pomiaru odchyłek geometrycznych (FMM), ich klasyfikacja i podstawowe bloki funkcyjne. Porównanie właściwości maszyn z obrotową głowicą i z obrotowym stołem. Maszyny FMM a maszyny współrzędnościowe CMM. Przykłady uniwersalnych maszyn FMM – realizowane funkcje, zakresy pomiarowe, osiągane dokładności. Rozwiązania konstrukcyjne głównych zespołów konstrukcyjnych. Zasady obsługi. Sterowanie zespołami i przetwarzanie sygnałów pomiaro¬wych. Filtry mechaniczne, analogowe i numeryczne. Geometria końcówki pomiarowej.. Wizualizacja i interpretacja wyników badań. Przykłady raportów. Źródła niepewności pomiarów odchyłek kształtu, położenia i kierunku. Wpływ pozycjonowania badanych elementów względem zespołów maszyny pomiarowej na dokładność pomiarów.
Przyczyny powstawania chropowatości i falistości powierzchni. Parametry mikrogeometrii według norm PN-EN-ISO i ich związki z własnościami elementów maszynowych. Metody pomiaru. Przyrządy do pomiarów chropowatości i falistości powierzchni. Wpływ parametrów pomiarowych na wartość wyznaczanych parametrów profilu. Przykłady wyników pomiaru i ich interpretacja Aktywne pomiary chropowatości powierzchni. Ograniczenia występujące w dwuwymiarowych pomiarach chropowatości. Podstawy przestrzennego opisu chropowatości. Wybrane parametry powierzchniowe i ich związki z własnościami eksploatacyjnymi wyrobów.
Standardowe porty komputera PC. Akwizycja danych pomiarowych. Sterowanie urządzeniami wykonawczymi typu mikrosilniki prądu stałego i skokowe z wykorzystaniem portu równoległego i szeregowego. Zastosowanie mikrokontrolerów do komunikacji pomiędzy urządzeniem pomiarowym a komputerem.
Laboratorium:
Pomiary za pomocą uniwersalnych cyfrowych maszyn pomiarowych FMM z obrotowym stołem. Wyznaczanie kształtu profili poprzecznych powierzchni obrotowych oraz odchyłki walcowości. Pomiary odchyłki prostoliniowości w przekrojach i w przestrzeni (linia środkowa powierzchni obrotowej). Wyznaczenie odchyłek kierunku i położenia. Analiza harmoniczna zarysów. Ocena zgodności elementów ze specyfikacją.
Pomiary geometrii krzywek sterujących zaworami silnika na stanowisku do badania wałów rozrządu.
Pomiary chropowatości powierzchni próbek wykonanych w wybranych procesach technologicznych przy użyciu profilometrów cyfrowych mierzących metodą stykową i bezstykową. Badania wpływu charakterystyki i pasma przenoszenia filtrów na kształt odwzorowania profili i wartość parametrów chropowatości.
Pomiary bardzo gładkich powierzchni (Rt < 1µm) profilometrem interferencyjnym z komputerową analizą wyników.
Akwizycja sygnałów binarnych na przykładzie obsługi klawiatury matrycowej i przetwornika inkrementalnego. Przesyłanie informacji w sposób szeregowy i równoległy. Wykorzystanie interfejsu szeregowego RS232. Programowanie mikrokontrolera w środowisku BASCOM - przykład zmiany postaci informacji.

**Metody oceny:**

Wykład:
egzamin
Laboratorium:
sprawdzian przygotowania do ćwiczeń
ocena pracy w czasie laboratorium
ocena wykonania sprawozdania

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni. WNT, 2008.
Baranowski. R.: Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce. Wyd. BTC 2005.
Arendarski J.: Niepewność pomiarów. Oficyna Wydawnicza PW, 2006.
Tomasik J. (red.).: Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta. Oficyna Wydawnicza PW, 2009.
Humienny Z. (red): Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Podręcznik europejski. WNT, 2004.
Liubimov V., Oczoś K.: Struktura geometryczna powierzchni. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003.
Malinowski J., Jakubiec W.: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, 2007
Metzger P. : Anatomia PC. Wyd. Helion 2002.
Piotrowski, J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. PWN, 2000.
Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli o chropowatości i nie tylko. Wyd. Politechnika Poznańska, 2003.
Żebrowska-Łucyk S.: Bezodniesieniowa metoda pomiaru makrogeometrii powierzchni elementów mechanicznych. Oficyna Wydawnicza PW, 2001.
Normy PN-EN ISO: 1101, 8015, 14253, 14405, 14406, 14660-1, 14660-2, 17450-1, 2692, 4287, 5436, 5458, 11562, 12179, 13565.
Normy ISO: 11562, 3274.
Dokumenty ISO/TS: 12180-1, 12181-1, 12780-1, 12781-1, 17450-2.

**Witryna www przedmiotu:**

brak

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt ASJ\_W01:**

Rozumie pojęcia związane ze specyfikowaniem i sprawdzaniem struktury geometrycznej powierzchni w zakresie makro- i mikrogeometrii, z uwzględnieniem terminów i zaleceń wprowadzonych w najnowszych międzynarodowych dokumentach normalizacyjnych. Zna zależności matematyczne stosowane do analizy sygnałów odwzorowujących kształt powierzchni (w dziedzinie czasu i częstotliwości) oraz w procesie filtrowania tych sygnałów w celu wydzielenia składowych wpływających na badane właściwości powierzchni

Weryfikacja:

Egzamin

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W01, K\_W10, K\_W13

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W01, T2A\_W02, T2A\_W04, T1A\_W03, T1A\_W04

**Efekt ASJ\_W02:**

Zna metody pomiaru chropowatości, falistości i odchyłek kształtu. Ma wiedzę na temat budowy, działania i dokładności nowoczesnych profilometrów, konturografów oraz maszyn do pomiaru odchyłek kształtu. Ma wiedzę na temat związków między parametrami procesu technologicznego, struktury geometrycznej powierzchni i wybranymi właściwościami eksploatacyjnymi wyrobów. Rozumie problemy techniczne związane z doskonaleniem jakości wyrobów.

Weryfikacja:

Egzamin

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W10, K\_W12, K\_W16, K\_W17

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_W02, T2A\_W04, T1A\_W02, T1A\_W03, T1A\_W04, T1A\_W05

**Efekt ASJ\_W03 :**

Ma wiedzę na temat budowy i obsługi portu równoległego i szeregowego komputera PC. Wie jak wykorzystać porty komputera do akwizycji sygnałów binarnych i sterowania mikrosilnikami.

Weryfikacja:

Egzamin

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W05, K\_W07, K\_W09

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W02, T1A\_W04, T1A\_W03, T1A\_W04, T1A\_W02, T1A\_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt ASJ1\_U01:**

Potrafi posługiwać się aparaturą do pomiaru mikro- i makrostruktury powierzchni elementów konstrukcyjnych, obejmującą profilometry, konturografy oraz uniwersalne maszyny do pomiaru odchyłek kształtu. Umie ustalić optymalną strategię pomiarową, przygotować elementy do pomiarów, dobrać właściwe nastawy przyrządu i parametry pomiaru. Wykazuje się sprawnością w interpretacji uzyskanych wyników, potrafi oszacować ich niepewność.

Weryfikacja:

Ocena poprawności wykonania zadań w laboratorium i sprawozdań z ćwiczeń.

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U10, K\_U11, K\_U13, K\_U15

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U07, T1A\_U08, T1A\_U09, T1A\_U02, T1A\_U08, T1A\_U09, T1A\_U08, T1A\_U16, T1A\_U09, T1A\_U16

**Efekt ASJ1\_U02:**

Potrafi samodzielnie wykonać obliczenia wybranych elementów geometrycznych skojarzonych według kryterium Gaussa oraz wyznaczyć miary liczbowe niedokładności badanych powierzchni. Umie obliczyć składowe harmoniczne widma profilu i oszacować ich wpływ na pracę elementu w zmontowanym zespole. Na podstawie wyników pomiaru geometrii krzywek umie wyznaczyć chwilowe prędkości i przyspieszenia popychaczy. Potrafi dobrać odpowiednie formy graficzne do zilustrowania uzyskanych wyników pomiaru oraz oszacować niepewność pomiaru wyznaczonych parametrów.

Weryfikacja:

Ocena poprawności wykonania zadań w laboratorium i jakości sprawozdań z ćwiczeń.

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U10, K\_U11, K\_U16, K\_U22

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U07, T1A\_U08, T1A\_U09, T1A\_U02, T1A\_U08, T1A\_U09, T1A\_U07, T1A\_U07, T1A\_U15

**Efekt ASJ1\_U03:**

Potrafi wykorzystać porty komputera PC do akwizycji danych pomiarowych oraz zaprogramować mikrokontroler do transmisji sygnałów.

Weryfikacja:

Sprawdzenie efektów funkcjonowania napisanego programu.

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U10, K\_U16, K\_U18

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U07, T1A\_U08, T1A\_U09, T1A\_U07, T1A\_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt ASJ\_K01:**

Potrafi określić priorytety oraz rozstrzygać dylematy związane z realizacją zadań pomiarowych. Umie pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.

Weryfikacja:

Przebieg zajęć laboratoryjnych i dyskusja na temat uzyskanych wyników.

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K04, K\_K05

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_K03, T1A\_K04, T1A\_K05, T1A\_K06

**Efekt ASJ\_K02:**

Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania oraz kontroli i rozumie jej wpływ na ekonomię i rozwój społeczny

Weryfikacja:

Egzamin

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K02, K\_K03

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_K02, T1A\_K02, T1A\_K07